# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/014727

International filing date: 27 December 2004 (27.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: US

Number: 60/592,208

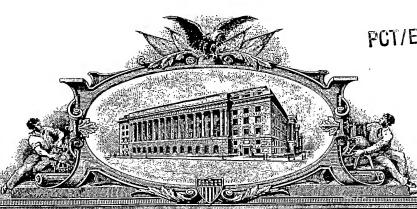
Filing date: 29 July 2004 (29.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 01 April 2005 (01.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





1 6. <sub>03. 2005</sub>

#### RATION OF THE CANADA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO

TO ALL TO WHOM THIRST: PRESENTS SHALL COMES

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

**United States Patent and Trademark Office** 

November 24, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/592,208

FILING DATE: July 29, 2004

By Authority of the

COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

P. SWAIN

**Certifying Officer** 

## PTO/SB/16 (01-04) Approved for use through 7/31/2006. OMB 0651-0032 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

Express Mail Label No.							- 8	
INVENTOR(S)								_ <u>⊃</u> .C/
Residence							20	
Given Name (first and r Susanne	niddle [if any] )	Family Name of Beder	or Sumame		berkochen, Ge	rmar	TO Foreigh Count	2264 60/
Alexander		Epple			berkochen, Ge	ermar	., 1∨	్గ్గర
Toralf		Gruner			berkochen, Ge	ermar	ný	
	rentors are being	named on the	1 separ	ratoly n	umbered sheets at	tache	d hereto	
Additional inv		ITLE OF THE INVE						
Projection Appara				Citara	·			
1 Tojection Appare	100 101 000 111	i iiio, o.i.i.iog. ap.i.,						
	- 1 - 201	RRESPONDENCE	ADDDECC					
Direct all corresponden	<u> </u>	07278	ADDRESS	1				
X Customer Number	er:	07278		1				
OR								
Firm or Individual Name	Melvin C. Ga							
Address	P.O. Box 52		<u></u> ,					
Mudicas		<b>~</b> .						
City	New York		State	NY		Zip	10150-5257	
Country	US				527-7700	Fax	(212) 753-62	37
	ENC	LOSED APPLICAT	ION PARTS	(chec	k all that apply)			
x Specification N	umber of Page	es 28	CD	(s), Nu	mber			
x Drawing(s) Nur	nber of Sheets	15	x Oth	er [	Certificate of E	vnre	ee Mailing (1 r	Jaue).
x Application Dat			L	1	Return Receipt			,ugo,,
l			• • •	_ · · [				
METHOD OF PAYME				AL APP	LICATION FOR I	PATE	N I	
Applicant claim	s small entity s	status. See 37 CF	R 1.27.				FILING FEE	ı
x A check or mor	ney order is en	closed to cover the	e filing fees.				AMOUNT (\$	
The Director is	hereby author	ized to charge filin	g					
fees or credit a	ny overpayme	nt to Deposit Acco	unt Number	:	04-0100		160.00	
Payment by cre	edit card. Form	n PTO-2038 is atta	ached.					
The invention was m	ade by an agend	cy of the United State	es Governme	nt or un	der a contract with	an ag	ency of the	
United States Govern							•	
		he U.S. Government nt contract number a						
			Page 1 of 2	)			<del></del>	
Respectfully submitte	d,	Fryn BARE			Date	J	uly 29, 2004	
0.01471105	AL.	_ (53.970)	<b>ઝ</b> •√		<del></del>			
SIGNATURE TYPED OR	da	-(05,776)		RF	EGISTRATION N	10.		
PRINTED NAME	Melvin C.	Garner			appropriate)	. <b></b>	26,272	<u> </u>
TELEPHONE (212) 527-7717 Docket Number: 01641/0201711-					1-US0			
		FOR FILING A PR	OVISIONAL					
	USE UNLT	FOR FILING A PR	UVISIUIVAL	AIT.	IOATION FOR P	m : <b>L</b> I\	••	

Express Mail Label No.

{W:\01641\0201711us0\00227480.DOC @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

#### PROVISIONAL APPLICATION COVER SHEET Additional Page

PTO/SB/16 (08-03)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Docket Number 01641/0201711-US0								
INVENTOR(S)/APPLICANT(S)								
Given Name (first and middle [if any])	Family or Surname	Residence (City and either State or Foreign Country)						
Bernard Norbert	Kneer Wabra	Oberkochen, Germany Oberkochen, Germany						

Page 2 of 2

PTO/SB/17 (10-03)
Approved for use through 7/31/2008, OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FFF TDANCAUTTAL		Complete if Known					
FEE TRANSMITTAL		Application Number Not Yet Assigned					
for FY 2004	Γ	Filing l	Date	ate Concurrently Herewith			
		First Named Inventor Susanne Beder			tor Susanne Beder		
Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.	_	Exami	_		Not Yet Assigned		
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art Uni	t		N/A		
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 160.00		Attome		ket No	o. 01641/0201711-US0		
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)					CALCULATION (continued)		
Credit Money	2 AI	DDITIC	MAL				
X Check Card Order Other None	J. AI	DUITE	MAKE !	LLU			
Deposit Account:	Large	Entity	Small	Entity			
Deposit Account 04-0100	Fee	Fee	Fee	Fee	Fee Description		
Number	Code	(\$)	Code	(\$)	Fee Paid		
Deposit Account Darby & Darby P.C.	1051	130	2051		Surcharge – late filing fee or oath		
Name The Director is authorized to: (check all that apply)	1052	50	2052		Surcharge – late provisional filing fee or cover sheet.		
Charge fee(s) indicated below X Credit any overpayments	1053	130	1053		Non-English specification		
	1812	2,520	1812		For filing a request for expante reexamination		
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)		1			Requesting publication of SIR prior to		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1804	920*	1804	920	Examiner action		
to the above-identified deposit account.	1805	1,840*	1805	1,040	Examiner action		
FEE CALCULATION	1251	110	2251		Extension for reply within first month		
1. BASIC FILING FEE	1252 1253	420 950	2252 2253		Extension for reply within second month  Extension for reply within third month		
Large Entity Small Entity  Fee Fee Fee Fee Fee <u>Fee Description</u> Fee Pald	1254	1,480	2254	740	Extension for reply within fourth month		
Code (\$) Code (\$)	1255	2,010	2255				
1001 770 2001 385 Utility filing fee 1002 340 2002 170 Design filing fee	1401	330	2401		Notice of Appeal		
1002 340 2002 170 Design limit lee	1402	330	2402		Filing a brief in support of an appeal		
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1403	290	2403	145	Request for oral hearing		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee 160.00	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 160.00	1452	110	2452	55	Petition to revive – unavoidable		
	1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE  Extra Fee from	1501	1,330	2501	665	Utility Issue fee (or reissue)		
Claims below Fee Paid	1502 1503	480 640	2502 2503	240 320	Design issue fee Plant issue fee		
Total Claims x = Independent x	1460	130	1460	130	Petitions to the Commissioner		
Claims	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)		
Multiple Dependent	1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt		
Large Entity Small Entity Fee		40	8021	40	Recording each patent assignment per		
Code (\$) Code (\$)	8021		1		property (times number of properties) Filing a submission after final rejection		
1202   18   2202   9   Claims in excess of 20   1201   86   2201   43   Independent claims in excess of 3	1809	770	2809	385	(37 ČFR 1.129(a))		
1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3  1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid	1810	770	2810	385	For each additional Invention to be examined (37CFR 1.129(b))		
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims	1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)		
over original patent 1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20	1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application		
and over original patent	Other	fee (spe	cify)				
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	*Redu	iced by I	Basic Fi	ling Fee	Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		
**or number previously paid, if greater, For Reissues, see above							
SUBMITTED BY			. ,		(Complete (if applicable))		
Name (Print/Type) Melvin C. Garner		ration No ey/Agent		,272	Telephone (212) 527-7717		
Signature The FLYNN BARRESON (	53,	970	)		Date July 29, 2004		
7		•••					

Dated: Express Mail Label No.

Application No. (if known):

Certificate of Express Mailing Under 37 CFR 1.10

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as Express Mail, Airbill No.

EL 9 9 6 1 2 0 8 9 4 TUS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

on July 29, 2004
Date

Typed or printed name of person signing Certificate

Note: Each paper must have its own certificate of mailing, or this certificate must identify each submitted paper.

Provisional Application for Patent Cover Sheet (2 pages);

Fee Transmittal (1 page);

Application Data Sheet (3 pages)

Specification (21 pages);

Claims (6 pages);

Abstract (1 page);

15 Sheets of Drawings

Check No. 5635 for \$160.00

Return Receipt Postcard

{W:\01641\0201711us0\00227477.DOC

10

### Mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage

Diese Anmeldung umfasst und ergänzt die US Provisional Application 60/544,967 vom 13. Februar 2004 der Erfinder Susanne Beder, Alexander Epple, Toralf Gruner, Bernhard Kneer und Norbert Wabra, welche hiermit in vollem Umfang zum Teil auch dieser Anmeldung erklärt wird.

Die Erfindung betrifft mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlagen, wie sie zur Herstellung hochintegrierter elektrischer Schaltkreise und anderer mikrostrukturierter Bauelemente verwendet werden. Die Erfindung betrifft insbesondere ein Projektionsobjektiv, das für einen Immersionsbetrieb ausgelegt ist, d.h. mit einer bildseitigen numerischen Apertur größer als 0.95 und mit einem Medium mit Brechungsindex größer als 1.0 (Immersionsmedium) angrenzend an die Bildebene, das zu belichtende Objekt, den Wafer.

Integrierte elektrische Schaltkreise und andere mikrostrukturierte Bauelemente werden
 üblicherweise hergestellt, indem auf ein geeignetes Substrat, bei dem es sich beispielsweise um einen Silizium-Wafer handeln kann, mehrere strukturierte Schichten aufgebracht werden. Zur Strukturierung der Schichten werden diese zunächst mit einem Photolack bedeckt, der für Licht eines bestimmten Wellenlängenbereiches empfindlich ist. Der Photolack kann mehrschichtig sein und auch zum Beispiel Antireflexschichten umfassen. Anschließend wird der so beschichtete Wafer in einer Projektionsbelichtungsanlage belichtet. Dabei wird ein Muster aus Strukturen, das sich auf einer Maske befindet, auf den Photolack mit Hilfe eines Projektionsobjektivs abgebildet. Da der Abbildungsmaßstab dabei im allgemeinen kleiner als 1 ist, werden derartige Projektionsobjektive häufig auch als Reduktionsobjektive bezeichnet.

Nach dem Entwickeln des Photolacks wird der Wafer einem Ätz- oder Abscheideprozeß unterzogen, wodurch die oberste Schicht entsprechend dem Muster auf der Maske strukturiert wird. Der noch verbliebene Photolack wird dann von den verbleibenden Teilen der Schicht entfernt. Dieser Prozeß wird so oft wiederholt, bis alle strukturierten Schichten auf dem Wafer aufgebracht sind.

Eines der wesentlichen Ziele bei der Entwicklung der bei der Herstellung eingesetzten
Projektionsbelichtungsanlagen besteht darin, Strukturen mit zunehmend kleineren
Abmessungen lithographisch definieren zu können. Kleine Strukturen führen zu hohen
Integrationsdichten, was sich im allgemeinen günstig auf die Leistungsfähigkeit der mit Hilfe derartiger Anlagen hergestellten mikrostrukturierten Bauelemente auswirkt.

Die Größe der definierbaren Strukturen hängt vor allem von dem Auflösungsvermögen des verwendeten Projektionsobjektivs ab. Da das Auflösungsvermögen der Projektionsobjektive sich mit kürzer werdenden Wellenlängen des Projektionslichts verbessert, besteht ein Ansatz zur Erhöhung des Auflösungsvermögens darin, Projektionslicht mit immer kürzeren Wellenlängen einzusetzen. Die kürzesten zur Zeit verwendeten oder näher untersuchten Wellenlängen liegen im tiefen ultravioletten Spektralbereich (DUV, deep ultraviolet) und betragen 248nm, 193 nm und 157 nm.

Ein anderer Ansatz zur Erhöhung des Auflösungsvermögens geht von der Überlegung aus, in den Zwischenraum, der zwischen einer bildseitig letzten Linse des Projektionsobjektivs und dem Photolack oder einer anderen zu belichtenden lichtempfindlichen Schicht verbleibt, ein Medium (Immersionsflüssigkeit) mit hoher Brechzahl einzubringen. Projektionsobjektive, die für den Immersionsbetrieb ausgelegt sind und deswegen auch als Immersionsobjektive bezeichnet werden, können bildseitige numerische Aperturen von mehr als 1.0, zum Beispiel 1.3 oder 1.4, erreichen. Die Immersion ermöglicht jedoch nicht nur hohe numerische Aperturen und dadurch ein vergrößertes Auflösungsvermögen, sondern wirkt sich auch günstig auf die Schärfentiefe aus. Je größer die Schärfentiefe ist, desto weniger hoch sind die Anforderungen an eine exakte Positionierung des Wafers in der Bildebene des Projektionsobjektivs.

10

15

20

25

30

Bei der verkleinernden optischen Abbildung, insbesondere bei der Projektionslithographie, ist die numerische Apertur durch die Brechzahl des umgebenden Mediums im Bildraum beschränkt. Bei der Immersionslithographie ist die theoretisch mögliche Numerische Apertur also durch die Brechzahl des Immersionsmediums beschränkt. Das Immersionsmedium kann eine Flüssigkeit oder ein Festkörper sein.

Insbesondere wenn eine Flüssigkeit eingesetzt wird mit höherer Brechzahl als eines der verfügbaren Linsenmaterialien, das sind vorwiegend Quarz und Fluoridkristalle, hier besonders CaF<sub>2</sub>, besteht das Problem, daß die hohe Brechzahl des Immersionsmediums mit herkömmlicher Gestaltung der Abschlusslinse des Projektionsobjektives mit planer Abschlussfläche nicht vollständig in eine höhere numerische Apertur umgesetzt werden kann. Das Problem liegt darin begründet, dass beim Übergang an Planflächen die (lokale) numerische Apertur durch das Medium mit der geringsten Brechzahl limitiert ist.

Die Apertur soll aus praktischen Gründen nicht beliebig nahe an die Brechzahl des letzen Mediums kommen, da die Ausbreitungswinkel dann relativ zur optischen Achse sehr groß werden. Es hat sich als praktisch erwiesen, wenn die Apertur etwa 95% der Brechzahl des letzten Mediums nicht wesentlich übersteigt. Dies entspricht Ausbreitungswinkeln von etwa 72° bezogen auf die optische Achse. Bei Wasser als Immersionsmedium für 193nm enspricht dies einer numerischen Apertur von NA = 1.35 ( $n_{H2O} = 1.43$ ). Mit einer Immersionsflüssigkeit mit einer Brechzahl von n = 1.6 sind damit numerische Aperturen von mindestens NA = 1.5 erreichbar. Dies entspricht aber bereits der Brechzahl von  $CaF_2$ .

- Für die letzte Linse kommen bei DUV (248nm bzw. 193nm Betriebwellenlänge) üblicherweise die Materialien Quarz (SiO<sub>2</sub>) mit einer Brechzahl von n<sub>SiO2</sub> = 1.56 oder CaF<sub>2</sub> mit Brechzahlen von n<sub>CaF2</sub> = 1.50 zum Einsatz (Brechzahlen bei 193nm). Aufgrund der hohen Strahlungsbelastung in den letzten Linsenelementen wird insbesondere für die letzte Linse bei 193nm Kalziumfluorid bevorzugt, da Quarz durch die Strahlungsbelastung
  langfristig geschädigt würde. Damit erreicht man praktikabel eine numerische Apertur von etwa 1.425 (95% von n = 1.5). Nimmt man den Nachteil der Strahlungsschädigung in Kauf, erreicht man mit Quarz immerhin Aperturen von 1.48 (entspricht etwa 95% der Brechzahl von Quarz bei 193nm). Bei 248nm sind die Verhältnisse ähnlich.
- Die hohen Winkel an der letzten Grenzfläche zwischen letztem optischem Element der Projektionsoptik und der Immersionsflüssigkeit führen zu einer starken Empfindlichkeit der Grenzfläche gegenüber Design- und Fertigungsfehlern. Es ist allgemein bekannt, dass beispielsweise die sphärische Aberration, wie allgemein alle Bildfehler, sehr stark mit den Einfallswinkeln an Grenzflächen zunehmen. Das Problem besteht also, ein hochaperturiges

Design anzugeben, das die Nachteile herkömmlicher Designs mit Immersionsmedien wie Wasser bzw. Linsen-Materialien bestehend aus Quarz oder CaF<sub>2</sub> umgeht.

- Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Projektionsobjektiv, das zur Abbildung einer in einer Objektebene des Projektionsobjektivs anordenbaren Maske auf eine in einer Bildebene des Projektionsobjektivs anordenbare lichtempfindliche Schicht vorgesehen ist. Das Projektionsobjektiv ist für einen Immersionsbetrieb ausgelegt, bei dem eine Immersionsflüssigkeit an die lichtempfindliche Schicht angrenzt.
- 10 Erfindungsgemäß ist zur Reduktion der Einfallswinkel an der letzten Grenzfläche das Projektionsobjektiv so ausgelegt, daß die Immersionsflüssigkeit zur Objektebene hin konvex gekrümmt an das letzte Linsenelement desProjektionsobjektivs anschließt.
- Die erfinderische Lösung besteht in einem strahlungsfesten Lithographieobjektiv mit bildseitiger numerischer Apertur vorzugsweise größer oder gleich NA = 1.35, bei dem wenigstens das letzte Linsenelement eine gekrümmte Abschlussfläche hat.

20

35

40

45

- Bei dem in der Lithographie üblichen (betragsmäßigen) Abbildungsmaßstab von 4:1 (|β| = 0.25) beträgt die objektseitige NA in diesen Fällen NA<sub>obj</sub> >= 0.3375, besonders bevorzugt NA >= 0.36.
- Durch die konvexe Krümmung der Immersionsflüssigkeit zur Objektebene hin werden die möglichen Strahleinfallswinkel vergrößert, unter denen Projektionslicht auf die Grenzfläche zwischen dem bildseitig letzten optischen Element und der Immersionsflüssigkeit auftreffen kann, ohne daß es dabei zu hohen Reflexionsverlusten kommt. Dies wiederum erlaubt eine höhere numerische Apertur, die nun auch über der Brechzahl des Materials liegen kann, aus dem das bildseitig letzte optische Element besteht. Begrenzt wird die numerische Apertur auf diese Weise nur noch durch die Brechzahl der Immersionsflüssigkeit, die an die lichtempfindliche Schicht angrenzt, nicht aber durch die Brechzahl des Materials, aus dem das bildseitig letzte optische Element besteht.

Die einfachste Möglichkeit, eine zur Objektebene hin konvex gekrümmte Immersionsflüssigkeit zu erzielen, besteht darin, die Immersionsflüssigkeit im Immersionsbetrieb unmittelbar an eine konkav gekrümmte bildseitige Fläche des bildseitig letzten optischen Elements angrenzen zu lassen. Die Krümmung der Immersionsflüssigkeit ist dann unveränderbar durch die Krümmung der bildseitig letzten Fläche des bildseitig letzten optischen Elements festgelegt.

Um ein unerwünschtes Ablaufen der Immersionsflüssigkeit aus dem Hohlraum zu verhindern, der durch die konkav gekrümmte bildseitige Fläche des bildseitig letzten optischen Elements gebildet wird, kann diese Fläche umfangsseitig von einer Ablaufsperre umgeben sein. Hierbei kann es sich beispielsweise um einen Ring handeln, der mit dem bildseitig letzten optischen Element verbunden ist. Der Ring, der beispielsweise aus einem üblichen Linsenmaterial wie Quarzglas oder Kalziumfluorid (CaF<sub>2</sub>), aber auch aus einer Keramik oder aus vergütetem Stahl bestehen kann, ist vorzugsweise innen mit einer Beschichtung versehen, die eine Kontamination der Immersionsflüssigkeit durch den Ring verhindert. Durch einen von außen ausgeübten geringen Druck oder durch Verhinderung des Eindringens von Luft oder Spülgasen wird dann verhindert, dass die Immersionsflüssigkeit aus dem konkaven Hohlraum ausläuft.

Bei diesen großen numerischen Aperturen werden nun die Winkel an einer herkömmlichen plan ausgelegten Abschlussfläche sehr groß bzw. ab numerischen Aperturen von der Größe der Brechzahl des letzten Mediums, beispielsweise im Falle von CaF2 ab einer Apertur von NA = 1.5 werden die Strahlen beim Übergang in das höherbrechende Immersionsmedium total reflektiert. Die Strahlung kann jedoch in das Immersionsmedium nutzbringend eingekoppelt werden, wenn die letzte Grenzfläche gekrümmt ausgelegt ist. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Einfallswinkel bezüglich der Flächennormale an der letzten Grenzfläche 60°, besonders bevorzugt 70° nicht übersteigen, um die Justage-Empfindlichkeit des letzten optischen Elementes und die Empfindlichkeit gegenüber Störungen und Verunreinigungen an der letzten Grenzfläche so gering wie möglich zu 10 halten. Besonders klein sind bei die Strahleinfallswinkel an der Grenzfläche zwischen dem bildseitig letzten optischen Element und der Immersionsflüssigkeit, wenn die bildseitige Fläche des bildseitig letzten optischen Elements zumindest im wesentlichen kugelschalenförmig (sphärisch) ist. Berechnungen haben ferner gezeigt, dass der Krümmungsradius der bildseitigen Fläche des bildseitig letzten optischen Elements dabei 15 vorzugsweise zwischen dem 0,9fachen und dem 1,5fachen und vorzugsweise das 1,3fache des axialen Abstandes zwischen der bildseitigen Fläche des bildseitig letzten optischen Elements und der Bildebene beträgt.

Andererseits ist es vorteilhaft, den Krümmungsradius der letzten Abschlußfläche so groß wie möglich zu wählen, um eine Turbulenzen freie Strömung des Immersionsmediums zu ermöglichen. Eine Strömung zum Auswechseln des Immersionsmediums ist aus Gründen der Temperaturstabilität und der Reinheit nützlich. Ferner ist es aus Gründen der erhöhten Absorption von hochbrechenden Immersionsflüssigkeiten vorteilhaft, den längsten Lichtweg durch das Immersionsmedium möglichst gering zu halten. Schließlich ist ein großer Krümmungsradius der letzten Abschlußfläche des Projektionsobjektives vorteilhaft für die Zugänglichkeit der letzten Fläche für Reinigungszwecke.

Für die erfindungsgemäß möglichen sehr hohen numerischen Aperturen, die beispielsweise 1,6 und darüber betragen können, ist eine neuartige Konzeption des Projektionsobjektivs besonders vorteilhaft. Bevorzugt ist dabei ein katadioptrisches Projektionsobjektiv mit mindestens zwei gekrümmten Spiegeln, in dem mindestens zwei Zwischenbilder entstehen.

In der Vergangenheit wurden optische Projektionssysteme mit stetig steigender numerischer Apertur entwickelt. Aus physikalischen Gründen (Vermeidung von Totalreflexion) muß dabei die numerische Apertur für Systeme mit einem waferseitigen Arbeitsabstand in Luft (Brechzahl nahe bei 1.0) unterhalb von NA 1.0 liegen.

Bei derart hohen numerischen Aperturen ist die Bereitstellung eines endlichen Arbeitsabstands am Wafer mit großen Schwierigkeiten verbunden. Dies liegt daran, daß in dem Gesamtsystem die Abbesche Sinusbedingung korrigiert werden muß. Details hierzu sind in der US provisional application 60/494,123 vom 12. August 2003 beschrieben.

Eine Möglichkeit, die Korrektur der Sinusbedingung zu erleichtern, ist es, die geometrischen Strahlwinkel im Waferraum (Bildraum) zu verringern. Dies kann durch eine Erhöhung des Brechungsindex bei fester NA geschehen.

30

35

45

Bei Immersionssystemen ist eben der Brechungsindex im Waferraum deutlich gegenüber den Luftsystemen erhöht. Die Brechzahl ist eher mit der Brechzahl im Glas der Linsen vergleichbar. In der Tat zeigt sich, daß Immersionssysteme bei gleicher NA wie vergleichbare Trockensysteme deutlich einfacher zu korrigieren sind.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnung.

#### Darin zeigen:

- 5 Figur 1 einen Meridionalschnitt durch eine
  mikrolithographische
  Projektionsbelichtungsanlage mit einem
  erfindungsgemäßen Projektionsobjektiv in einer
  stark vereinfachten, nicht maßstäblichen
  Darstellung;
  - Figur 2 eine vergrößerte Darstellung des bildseitigen Endes des in der Figur 1 gezeigten Projektionsobjektivs;
- Figur 3 eine der Figur 2 entsprechende Darstellung, bei der das Projektionsobjektiv jedoch zusätzlich mit einer Ablaufsperre versehen ist;
- Figur 4 das bildseitige Ende eines Projektionsobjektivs gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel, bei dem zwischen der Immersionsflüssigkeit und dem bildseitig letzten optischen Element eine Zwischenflüssigkeit eingebracht ist;

Figur 5 einen Meridionalschnitt durch ein vollständiges katadioptrisches Projektionsobjektiv gemäß der vorliegenden Erfindung.

Figur 6 bis 8 weitere Beipiele erfindungsgemäßer
5 Objektive im maßstäblichen Meridionalschnitt.

Die Figur 1 zeigt einen Meridionalschnitt durch eine insgesamt mit 110 bezeichnete mikrolithographische Projektionsbelichtungsanlage in stark vereinfachter, nicht maßstäblicher Darstellung. Die Projektionsbelichtungsanlage 110 weist eine Beleuchtungseinrichtung 112 zur Erzeugung von Projektionslicht 113 auf, die eine Lichtquelle 114, eine mit 116 angedeutete Beleuchtungsoptik und eine Blende 118 umfaßt. Das Projektionslicht 113 hat in dem dargestellten Ausführungsbeispiel eine Wellenlänge von 193 nm.

Zur Projektionsbelichtungsanlage 110 gehört ferner ein Projektionsobjektiv 120, das eine Vielzahl von Linsen enthält, von denen der Übersichtlichkeit halber in der Figur 1 lediglich einige beispielhaft angedeutet und mit L1 bis L5 bezeichnet sind. Das Projektionsobjektiv 120 dient dazu, eine in einer Objektebene 122 des Projektionsobjektivs 120 angeordnete Maske 124 verkleinert auf eine lichtempfindliche Schicht 126 abzubilden. Die Schicht 126, die zum Beispiel aus einem Photolack bestehen kann und mehrlagig sein kann und auch Antireflexschichten umfassen kann, ist in einer Bildebene 128 des Projektionsobjektivs 120 angeordnet und auf einem Träger 130 aufgebracht.

10

15

30

35

In einen Zwischenraum 132, der zwischen der bildseitig letzten Linse L5 und der lichtempfindlichen Schicht 126 verbleibt, ist eine Immersionsflüssigkeit 134 eingebracht.

Besonders gut ist dies in der Figur 2 erkennbar, in der das bildseitige Ende des Projektionsobjektivs 120 vergrößert dargestellt ist. Die bildseitig letzte Linse L5 weist bildseitig eine Fläche 136 auf, die konkav gekrümmt ist. Der Zwischenraum 132 zwischen der bildseitig letzten Linse L5 und der lichtempfindlichen Schicht 126 erhält dadurch die Form eines Hohlraums.

Die Fläche 136 ist annährend kugelschalenförmig (sphärisch), wobei der Krümmungsradius in der Figur 2 mit R bezeichnet ist. Der Krümmungsradius R beträgt dabei etwa das 1,3fache des axialen Abstandes d zwischen der bildseitig letzten Linse L5 und der lichtempfindlichen Schicht 126.

Die Immersionsflüssigkeit 134 hat eine Brechzahl n<sub>L</sub>, die größer ist als die Brechzahl des Materials n<sub>1</sub>, aus dem die bildseitig letzte Linse L5 besteht. Wird als Material beispielsweise Quarzglas oder Kalziumfluorid verwendet, so ist eine Flüssigkeit zu wählen, deren Brechzahl n<sub>L</sub> über 1,56 bzw. 1,5 liegt. Erreichen läßt sich dies beispielsweise durch Zusätze von Sulfaten, Alkalien wie z.B. Cäsium oder Phosphaten zu Wasser, wie dies auf der Internetseite www.eetimes.com/semi/news/OEG20040128S0017 beschrieben ist. Diese Immersionsflüssigkeiten haben auch bei Wellenlängen im ultravioletten Spektralbereich eine ausreichende Transparenz und Beständigkeit. Ist die Projektionsbelichtungsanlage 110 für längere Wellenlängen ausgelegt, z.B. für Wellenlängen im sichtbarem Spektralbereich, so können auch herkömmliche Immersionsflüssigkeiten mit hoher Brechzahl wie beispielsweise Zedernholzöl, Schwefelkohlenstoff oder Monobromnaphtalin als Immersionsflüssigkeit verwendet werden.

Da die Immersionsflüssigkeit zur Objektebene 122 hin eine konvex gekrümmte Grenzfläche 139 zur bildseitig letzten Linse L5 hat, treten an dieser Grenzfläche 139 nur relativ kleine Strahleinfallswinkel auf. Dies ist in der Figur 2 beispielhaft für Randstrahlen 113a und 113b gezeigt. Entsprechend gering sind dadurch Reflexionsverluste an dieser Grenzfläche. Dadurch können auch Strahlen mit großen Öffnungswinkeln zu einer optischen Achse 138 des Projektionsobjektivs 120 zur Abbildung beitragen, so daß sich mit dem Projektionsobjektiv 120 numerische Aperturen erzielen lassen, die bis an die Brechzahl n<sub>L</sub> der Immersionsflüssigkeit 134 heranreichen können. Wäre die Grenzfläche 139 hingegen plan, wie dies im Stand der Technik üblich ist, so wären diese Randstrahlen in der bildseitig letzten Linse L5 nicht ausbreitungsfähig.

Die Erfindung ist jedoch auch mit Immersionsmedien, deren Brechungsindex kleiner ist als derjenige der letzten Linse vorteilhaft, da auch in diesem Fall die geringeren Winkel an der Grenzfläche zu verbessertem und störungsärmerem Übergang des Lichts führen.

10

20

25

30

35

40

In der Figur 3 ist ein Projektionsobjektiv 120' gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel in einer an die Figur 2 angelehnten Darstellung gezeigt. Gleiche Teile sind dabei mit identischen Bezugsziffern gekennzeichnet.

Das Projektionsobjektiv 120' unterscheidet sich von dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Projektionsobjektiv 120 lediglich dadurch, daß die bildseitig letzte Linse L5 zur lichtempfindlichen Schicht 126 hin dichtend mit einem Ring 140 verbunden ist, der die Funktion einer Abflusssperre für die Immersionsflüssigkeit 134 hat. Eine solche Abflusssperre kann insbesondere bei starken Krümmungen der Fläche 136 der bildseitig letzten Linse L5 erforderlich sein, da der Zwischenraum 132 dann in Richtung der optischen Achse 138 eine große maximale Ausdehnung hat. Entsprechend hoch ist dementsprechend der hydrostatische Druck der Immersionsflüssigkeit 134. Ohne eine Abflusssperre kann dieser Druck eventuell dazu führen, dass die Immersionsflüssigkeit 134 aus dem Hohlraum in den umgebenden Spalt zwischen dem Projektionsobjektiv 120 und der lichtempfindlichen Schicht 126 gedrückt wird und auf diese Weise den Hohlraum verlässt.

Der Ring 140 kann beispielsweise aus einem üblichen Linsenmaterial wie Quarzglas oder Kalziumfluorid, aber auch aus anderen Materialien wie etwa Invar™-Nickellegierung oder Edelstahl, Glaskeramik oder einer Keramik bestehen.

Figur 4 zeigt die geometrischen Verhältnisse an der letzten Linsenfläche. Ein Aperturstrahl mit maximalem Aperturwinkel u ist zum Randpunkt des Bildfeldes der Höhe h zur optischen Achse OA eingezeichnet. Der Strahl hat an der letzten Grenzfläche einen Einfallswinkel i' und einen Ausfallswinkel i. Die Schnittweite zwischen dem Scheitelpunkt der letzten Fläche und der Bildebene, in der die Oberseite des mit z.B. Photolack beschichteten Wafers angeordnet wird, beträgt s.

Projektionssysteme werden grundsätzlich durch zwei Größen charakterisiert, die (bildseitige)numerische Apertur n sin u und die Größe (Durchmesser eines Kreises um die optische Achse) 2h des abzubildenden Feldes. Aus dem Wert der bildseitigen NA können zum einen geometrische Eigenschaften abgeleitet werden, um einen Durchtritt des Lichtes durch die letzte Linse sowie durch das Immersionsmedium sicherstellen zu können. Ferner folgen auch aus der Erfahrung des optischen Designs Anforderungen an die letzte Linse, die

30

40

in der Regel strenger als die physikalisch notwendigen sind. So sollte der Einfallswinkel i' an der letzten Grenzfläche einen bestimmten Wert nicht überschreiten, der beispielsweise bei etwa 75° liegt, besonders vorteilhaft ist es, wenn der Wert für i' 70° nicht übersteigt. Die Erfahrung zeigt nämlich, daß für ein System mit zunehmenden Inzidenzwinkeln der Strahlen an den brechenden Flächen des Systems die Komplexität (Schwierigkeit bei der Korrektur und Sensitivität gegenüber Fertigungstoleranzen und Veränderungen im Gebrauch) zunimmt.

Heutzutage gelten Trockensysteme bis etwa NA 0.95 als realisierbar, d.h. die numerische Apertur sollte 95% der Brechzahl des Mediums, welches der Bildebene direkt vorangeht, nicht überschreiten. In einem solchen System treten maximale Inzidenzwinkel von etwa 70° auf, insbesondere an den letzten, bildnahen (wafernahen) Flächen, aber auch an einzelnen weiteren Linsenflächen des Systems.

Daher ist erfindungsgemäß davon auszugehen, dass auch in einem bevorzugten Immersionssystem an äquivalenten Stellen die Inzidenzwinkel unter diesen Werten zu halten sind, um die Realisierbarkeit sicherzustellen. Ist die bildseitige numerische Apertur des Immersionsobjektiv größer als 95% der Brechzahl der letzten Linse, so ist es besonders vorteilhaft, die letzte Linsenfläche als eine Hohlfläche auszulegen, um an dieser Fläche den Einfallswinkel zu verringern. Es kann also vorteilhaft sein, dass die letzte Linsenfläche vor der Immersionsflüssigkeit nicht plan, insbesondere konkav ist.

Dies kann jedoch zu verstärkten Problemen der Strömungsmechanik, Kontamination und Temperatursensibilität des Immersionsraums führen: die Immersionsflüssigkeit kann in einem stark konvexen Hohlraum eingeschlossen sein, ein Purging – Ausstauch mit dem Ziel der Temperaturstabilisierung und Dekontamination – wird erschwert.

Daher soll die letzte Linsenfläche andererseits nicht zu stark gekrümmt sein.

Erfindungsgemäß wurde daher erkannt, dass es besonders vorteilhaft ist, wenn die folgende Bedingung eingehalten wird: 0.95 > sin(i') > 0.85.

Bei der Immersionslithographie mit Wasser kann die letzte Fläche des Objektivs auch durch I eine Planfläche gebildet werden, allerdings kann es aus verschiedenen Gründen, auch zur Entspannung des optischen Designs, auch da vorteilhaft sein, bereits bei geringeren numerischen Aperturen die letzte Linsenfläche gekrümmt auszulegen.

Wird jedoch ein Immersionsmedium verwendet, dessen Brechungsindex größer ist als derjenige der Abschlusslinse, so ist es in jedem Falle vorteilhaft; die Abschlussfläche konkav auszulegen. Im folgenden wird eine Formel angegeben, welche die geeignete Krümmung  $\rho$  in Abhängigkeit von NA = n sin u, Arbeitsabstand s, Bildhöhe h und den Brechzahlen n' der Linse und n der Flüssigkeit angibt, die geeignet ist, damit der Sinus des Einfallswinkels i' ein bestimmtes vorteilhaftes und praktikables Maß nicht überschreitet. Ein solcher Wert wurde gefunden mit sin (i') <  $\kappa$ , wobei  $\kappa$  = 0.95. Mit dem Brechungsgesetz folgt daraus die Forderung:

$$(1) \qquad \left| \frac{n}{n'} \sin i \right| < \kappa$$

Nach einfachen geometrischen Überlegungen kann daraus abgeleitet werden :

45 (2) 
$$\left|\frac{n}{n'}(s\rho-1)\sin u\right| > \kappa$$

woraus als Bedingung für die minimale Flächenkrümmung folgt:

(3) 
$$\rho > \frac{\left(1 - \frac{n' \cdot \kappa}{NA}\right)}{s}$$

Berücksichtigt man bei einem endlichen Bildfeld zusätzlich die Randstrahlen des äußersten Feldpunkts, genügt es dazu, in den obigen Formeln die Schnittweite s durch s' mit

$$(4) s' = s - \frac{h}{\tan u}$$

zu ersetzen. Für eine endliche Feldhöhe h folgt damit für die minimale Krümmung ho:

(5) 
$$\rho > \left(1 - \frac{n' \cdot \kappa}{NA}\right) / \left(s - \frac{h}{\tan u}\right)$$

Die Figur 5 zeigt einen Meridionalschnitt durch ein konkretes Ausführungsbeispiel des in den Figuren 1 und 2 gezeigten Projektionsobjektivs 120. Die Designdaten des Projektionsobjektivs sind in der Tabelle 1 aufgeführt; Radien und Dicken sind in Millimetern angegeben. In der Figur 5 weisen die Ziffern oberhalb des Projektionsobjektivs auf ausgewählte Flächen optischer Elemente hin. Flächen, die mit Gruppen kurzer waagerechter Linien gekennzeichnet sind, sind asphärisch gekrümmt. Die Krümmung dieser Flächen ist durch die nachfolgende Asphärenformel beschrieben:

$$z = \frac{ch^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k) c^2 h^2}} + Ah^4 + Bh^6 + Ch^8 + Dh^{10} + Eh^{12} + Fh^{14} + Gh^{16} + Hh^{18} + Jh^{20}$$

Dabei sind z die Pfeilhöhe der betreffenden Fläche parallel zur optischen Achse, h der radiale Abstand von der optischen Achse, c = 1/R die Scheitelkrümmung der betreffenden Fläche mit R als dem Krümmungsradius, k die konische Konstante und A, B, C, D, E, F, G, H und J die in der Tabelle 2 aufgeführten Asphärenkonstanten. Für die konische Konstante k gilt bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel k = 0.

Das Projektionsobjektiv 120 enthält zwei asphärische Spiegel S1 und S2, zwischen denen zwei (nicht optimal korrigierte) Zwischenbilder entstehen. Das Projektionsobjektiv 120 ist ausgelegt für eine Wellenlänge von 193 nm und eine Brechzahl n<sub>L</sub> der Immersionsflüssigkeit von 1,6. Der Abbildungsmaßstab des Projektionsobjektivs 120 beträgt ß = -0,25 und die numerische Apertur NA = 1,4. Durch einige zusätzliche Verbesserungen lässt sich aber ohne weiteres auch eine numerische Apertur NA erzielen, die knapp bis an die Brechzahl des Immersionsmediums heranreicht und somit nur geringfügig kleiner ist als 1,6.

In weiteren Ausführungsbeispielen werden Projektionsobjektive mit einer erfindungsgemäß gekrümmten letzten Linsenfläche angegeben, wobei der Strahlengang im Projektionsobjektiv nunmehr durch plane Faltspiegel gefaltet ist. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel bei 193nm, Abbildung 7 ein Beispiel bei 157nm Wellenlänge des verwendeten Laserlichts. In beiden Beispielen beträgt die numerische Apertur NA = 1.4, das Immersionsmedium hat eine Brechzahl von n = 1.6.

In Abbildung 8 ist schließlich ein Designbeispiel mit NA = 1.4 angegeben, in dem der Krümmungsradius der letzten Linsenfläche groß ausgelegt wurde, so dass die Krümmung gering ist und das Purging erleichtert wird.

- In der Vergangenheit wurden optische Projektionssysteme mit stetig steigender numerischer Apertur entwickelt. Aus physikalischen Gründen (Vermeidung von Totalreflexion) muß dabei die numerische Apertur für Systeme mit einem waferseitigen Arbeitsabstand in Luft (Brechzahl nahe bei 1.0) unterhalb von NA 1.0 liegen.
- Bei derart hohen numerischen Aperturen ist die Bereitstellung eines endlichen Arbeitsabstands am Wafer mit großen Schwierigkeiten Verbunden. Dies liegt daran, daß in dem Gesamtsystem die Abbesche Sinusbedingung korrigiert werden muß. Details hierzu sind in der E203204, angemeldet in der P43127US, beschrieben.
  - Eine Möglichkeit, die Korrektur der Sinusbedingung zu erleichtern, ist es, die geometrischen Strahlwinkel im Waferraum zu verringern. Dies kann durch eine Erhöhung des Brechungsindex bei fester NA geschehen.

20

- Bei Immersionssystemen ist eben der Brechungsindex im Waferraum deutlich gegenüber den Luftsystemen erhöht. Die Brechzahl ist eher mit der Brechzahl im Glas der Linsen vergleichbar. In der Tat zeigt sich, daß Immersionssysteme bei gleicher NA wie vergleichbare Trockensysteme deutlich einfacher zu korrigieren sind.
- 25 Ein weiterer Vorteil bei Verwendung von Immersionsflüssigkeiten liegt in der Tatsache begründet, daß hiermit numerische Aperturen größer 1.0, nämlich physikalisch sinnvoll bis zum Brechungsindex der Immersion, realisiert werden können. Bei Verwendung von Wasser (n=1.436 bei λ=193 nm) könnte man also theoretisch eine NA von knapp über 1.4 realisieren.
- In der Nähe dieser Grenze steigt jedoch der geometrische Strahlwinkel des Randstrahls erneut stark an, und die Korrektur der Sinusbedingung bei planer letzter Linsenfläche des Objektivs ist, vergleichbar mit den oben beschriebenen Trockensystemen, wieder deutlich erschwert.
- Um die geometrischen Strahlwinkel am Wafer zu reduzieren hilft es erneut, die Brechzahl des Immersionsmediums zu erhöhen, falls ein Immersionsmittel mit dementsprechenden Eigenschaften verfügbar ist. Somit werden die geometrischen Strahlwinkel bei konstanter num. Apertur erneut verringert.
  - Erhöht man den Brechungsindex der Immersion so stark, daß er höher ist als der Brechungsindex der davorliegenden Linse, so kann es im allgemeinen günstig sein, die letzte Linsenfläche stark hohl auszuführen, d.h. eine stark konvexe Immersionsschicht ("Flüssigkeitslinse") auszubilden.
- 40 Ist der Wert der numerischen Apertur des Objektivs größer als der Brechungsindex der letzten Linse, so ist die konkave Rückseite der letzten Linse aus physikalischen Gründen (Vermeidung von Totalreflexion) sogar unabdingbar. Dies wurde bereits in der E203460 formuliert
  - Aber auch wenn die numerische Apertur sowohl unterhalb der Brechzahl der letzten Linse als auch der Immersion liegt wird aufgrund der hohen Brechzahl der Immersion bei einer stark konvexen Immersionslinse die effektive NA in der letzten Glaslinse des Objektivs verringert. Dies wirkt sich

günstig auf die Korrigierbarkeit der Sinusbedingung und somit des gesamten Korrekturzustands des Objektivs aus.

Typischerweise bildet sich als Grenzfläche zwischen letzter Linse und Immersion eine um den Wafer nahezu konzentrische Fläche aus, d.h. die Immersionslinse bekommt starke Brechkraft.

Ein weiterer Vorteil einer solchen stark konvexen Immersionslinse ist, daß der Richtungskosinus des Randstrahls in der letzten Linse verringert wird. Ist diese Linse ihrerseits wieder Vorderseitig konvex, so kann die vorletzte Linse die Strahlen leichter "einfangen", die Strahlen können schneller in die Blende umgelenkt werden, es resultiert ein kleinerer Blendendurchmesser.

Es ist jedoch zu vermuten, daß eine stark konvexe Immersionslinse zu Problemen bei der Realisierung der Systeme führen kann, insbesondere hinsichtlich

- Purging-Konzept: ein stetiger Austausch der Immersionsflüssigkeit ist deutlich erschwert, da sich der stark erhabene Immersionsraum nur schlecht spülen läßt
- Kontamination: Bei einem eingeschränkten Austausch der Immersionsflüssigkeit können sich Schmutzpartikel im Immersionsraum fangen
- Aufheizung der Immersionsflüssigkeit: Bei schlechtem Austausch der Flüssigkeit ist zu erwarten, daß man aufgrund der hohen Strahlungsintensität am Wafer eine lokale Aufheizung der Immersionsflüssigkeit erhält, welche zu starken Aberrationen führen (entsprechend LensHeating Effekten).

Aus diesen Gründen wird es technisch vorteilhafter sein, die letzte Linsenfläche nicht zu krumm 20 auszubilden.

Die drei Ausführungsbeispiele Fig 6 bis 8 haben folgendes gemein:

- Bildseitige numerische Apertur NA = 1.40
- Der Brechungsindex der Immersion n<sub>i</sub>=1.60 ist stets größer als der Brechungsindex des letzten Glases: n<sub>i</sub>>n<sub>G</sub>
- Bei Fig .6 handelt es sich um ein nicht-achromatisiertes Design für die Wellenlänge
   193 nm:
  - Die Immersionsschicht ist stark erhaben und im wesentlichen konzentrisch um den Wafer.
- In der letzten Linse ist CaF2 mit n<sub>G</sub>=1.50

35

Die Korrektur der Wellenfront beträgt rund 20 mλ

Bei Fig. 7 handelt es sich um ein vollachromatisiertes Design für die Wellenlänge 157 nm.

- Die Immersionsschicht ist stark erhaben und im wesentlichen konzentrisch um den Wafer.
- In der letzten Linse ist CaF2 mit n<sub>G</sub>=1.56
- Die Korrektur der Wellenfront beträgt rund 40 mλ

Bei Fig.8 handelt es sich um ein nicht-achromatisiertes Design für die Wellenlänge 193 nm:

- Die Immersionsschicht ist deutlich flacher als bei Fig. 6 und weit von "konzentrisch um den Wafer" entfernt. Es resultiert daraus ein maximaler i-Winkel von 0.92 auf der letzten Linsenfläche.
- In der letzten Linse ist CaF2 mit n<sub>G</sub>=1.50
- Die Korrektur der Wellenfront beträgt rund 50 mλ
- 10 Im Vergleich von Fig. 6 und Fig. 8 zeigt sich, daß die stark konvexe Immersionsschicht an sich das Design sehr erleichtert.

Ferner ist es schwierig, bei einer flacheren Immersionsschicht den Arbeitsabstand zu verringern. Es ist also ein erfindungsgemäß vorgesehener Kompromiss der Krümmung angezeigt.

- Es wurde auch festgestellt, dass für das Design eine Regel gilt: "verhindere zu stark divergierende Strahlengänge am Wafer, wenn man vom Wafer zum Retikel hin denkt". Dies kann etwa über eine Beschränkung des meridionalen Richtungskosinus erfolgen. Seien k, l, m die drei Richtungskosines des Randstrahls und n der Brechungsindex der Fläche, so daß gilt k²+l²+m² = n², dann gibt es keinen optischen Raum im Objektiv, in dem (k²+l²)/n²>K<sub>0</sub> is. Dabei ist für Ko zu fordern, dass K<sub>0</sub>=0.95, besser noch 0.85 ist. Auch dies wird durch die Verwendung einer hochbrechenden, konvexen Immersionslinse am Wafer unterstützt und verhindert große Linsendurchmesser in der Nähe der Blendenebene im wafernächsten Teilobjektiv.
- Es versteht sich, dass die vorliegende Erfindung nicht auf die Verwendung in katadioptrischen Projektionsobjektiven der vorstehend beschriebenen Typen beschränkt ist. Ebenso gut kann die Erfindung auch in Projektionsobjektiven mit anders gefalteten Strahlengängen oder anderer Zahl von Zwischenbildern oder auch in rein refraktiven Objektiven mit oder ohne Zwischenbild eingesetzt werden. Das Bildfeld kann zentriert zur optischen Achse oder dezentriert (off axis) liegen. Beispiele für geeignete Objektivdesigns, von denen erfindungsgemäße Abwandlungen ausgehen können, finden sich unter anderem in der US 2002/0196533 A1, der WO 150171 A1, der WO 02/093209 A2 und der US 6496306 A der Anmelderin (assignee), deren Offenbarungsgehalte hiermit vollumfänglich mit aufgenommen werden.
- Der Gegenstand der Erfindung umfasst auch alle nicht expliziten Kombinationen von Merkmalen aus den verschiedenen Ansprüchen und aus der Beschreibung.

Tabelle 1: Designdaten zu Fig.5

Fläche	Radius	Asphäre	Dicke	Material
Objektebene	0		37,648	
1	210,931		21,995	SiO <sub>2</sub>
2	909,02		1,605	
3	673,572		22,728	SiO <sub>2</sub>
4	-338,735	х	33,19	
5	130,215	х	8,994	SiO <sub>2</sub>
6	119,808		36,001	
7	216		40,356	SiO <sub>2</sub>
8	-210,59		0,939	
9	97,24		49,504	SiO₂
10	216,208	х	8,164	
12	-65,704		49,734	SiO₂
Blende	0		49,302	
13	-113,325		55,26	
14	-6210,149	x	70,31	SiO <sub>2</sub>
15	-195,536		0,962	
16	3980,16		65,997	SiO <sub>2</sub>
17	-473,059		277,072	
18	-225,942	х	246,731	Spiegel
19	193,745	х	294,329	Spiegel
20	-338,56	х	17,389	SiO <sub>2</sub>
21	-206,244		8,884	
22	-148,97		34,064	SiO <sub>2</sub>
23	129,921	x	40,529	
24	-2704,885		33,192	SiO <sub>2</sub>
25	-195,599		0,946	
26	-794,214	x	30,169	SiO <sub>2</sub>
27	-479,39		24,236	
28	-311,778	x	100,056	SiO <sub>2</sub>
29	-159,333		28,806	
30	309,839		43,609	SiO <sub>2</sub>
31	836,077	х	0,951	
32	225,096		55,667	SiO <sub>2</sub>
33	687,556		0,945	
34	154,575		64,278	SiO <sub>2</sub>
35	911,8	х	0,932	
36	89,986		44,143	SiO <sub>2</sub>
37	199,475	х	0,878	
38	61,984		9,635	SiO <sub>2</sub>
, 39	35,475		34,43	Flüssigkeit

Tabelle 2: Asphärenkonstanten zu Tab.1, Fig. 5

Fläch	ne 4	Fläc	he 5	Fläche	e10
Α	5,36225288E-08	Α	2,53854010E-08	Α	4,51137087E-07
В	-5,17992581E-12	В	-1,22713179E-11	В	2,46833840E-11
С	8,49599769E-16	C	1,21417341E-15	С	5,78496960E-15
D	-7,57832730E-20	D	-1,92474180E-19	D	-4,39101683E-18
E	3,59228710E-24	Ε	2,08240691E-23	E	-5,64853356E-22
F	-9,16722201E-29	F	-9,29539601E-28	F	.4,95744749E-26
	•				
Fläch	ne 14	Fläc	he 18	Fläch	e 19
Α	-8,48905023E-09	Α	1,04673033E-08	Α	-4,11099367E-09
В	1,45061822E-13	В	1,34351117E-13	В	-9,91828838E- <sub>1</sub> 4
С	-6,34351367E-18	С	1,03389626E-18	С	-7,93614779E-19
D	2,84301572E-22	D	5,16847878E-23	D	-1,66363646E-22
Ε	-8,24902650E-27	E	-1,23928686E-27	E	5,56486530E-27
F	1,27798308E-31	F	3,09904827E-32	F	-1,79683490E-31
	•				
Fläci	he 20	Fläc	he 23	Fläch	
Α	1,14749646E-07	Α	-2,87603531E-08	Α	-4,35420789 <b>E-</b> 08
В	-8,19248307E-12	В	-9,68432739E-12	В	-6,70429494E-13
С	8,78420843E-16	С	6,88099059E-16	С	-4,05835225E-17
D	-1,39638210E-19	D	-8,70009838E-20	D	-1,10658303E-20
Ε	2,09064504E-23	E	9,59884320E-24	E	4,80978147E-25
F	-2,15981914E-27	F	-5,07639229E-28	F	-5,35014389E-29
Fläc	he 28	Fläd	che 31	Fläch	
Α	-2,70754285E-08	Α	4,38707762E-09	Α	1,73743303E-08
В	-1,36708653E-12	В	-3,69893805E-13	В	1,60994523E-12
С	-2,46085956E-17	С	-4,93747026E-18	С	-1,71036162E-16
D	2,26651081E-21	D	4,05461849E-22	D	1,26964535E-20
E	-1,20009586E-25	Ε	-7,59674606E-27	E	-5,77497378E-25
F	9,28622501E-30	F	5,58403314E-32	F	1,55390733E-29
				G	-1,78430224E-34
Fiäc	he 37				
Α	1,04975421E-07				
В -	1,94141448E-11				
C	-2,31145732E-15				
D	4,57201996E-19				
E	-3,92356845E-23				
F	2,35233647E-27				

9091.5

Tabelle 3 zu Beispiel Figur 6

SURF	RADIUS	THICKNESS N	ATERIAL	INDEX	SEMIDIAM.
0	0.0000	32.0000			65.50
1	0.0000	0.0000			80.45
2	332.4480	18.9959 S	102	1.560318	84.22
3	27083.8930	17.5539			85.42
4	-253.5666	26.7129 S	3102	1.560318	86.06
5	-179.3607	164.1318		•	90.72
6	1920.0084	34.5089 S	3102	1.560318	111.13
7	-279.4103	0.9461			111.59
8	213.6767	34.3917 S	8102	1.560318	103.48
9	17137.3629	26.7484			100.67
10	-208.9766	9.4997	SIO2	1.560318	99.22
11	-609.1513	0.9500			97.67
12	734.0560	18.8742	SIO2	1.560318	95.00
13	-1380.9253	24.2008			93.32
14	0.0000	231.0887			81.98
15	252.7510	74.6720	SIO2	1.560318	126.43
16	1098.5274				121.38
17	268.9906	50.1845	SIO2	1.560318	119.28
18	-463.5300				117.08
19	697.8278		SIO2	1.560318	106.59
20	292.0140				94.90
21	0.0000				82.23
22	0.0000			1.560318	
23	-178.0803		SIO2	1.560318	
24	-663.9291			4 500040	113.38
25	-237.9404		SIO2	1.560318	
26	-166.3412			4 500040	111.11 127.22
27	222.8026		S102	1.560318	138.91
28	539.8416				167.04
29	364.8709			1.560318	
30	539.8416		SIO2	1.500510	127.22
31	222.8026		CIOO	1.560318	
32	-166.3412		\$102	1,500510	115.72
33	-237.9404		8103	1.560318	
34	-663.9291		3102	1.000010	115.52
35					122.31
36	0.000.0 0.000.0	-			91.10
37					179.89
38			SIO2	1.560318	
39 40			0.02		96.62
40			SIO2	1.560318	3 106.20
42			0.02		105.01
43			SIO2	1.560318	3 77.96
44		-			95.09
45			REFL		109.51
46				1.560318	95.09
47					77.96
48			SIO2	1.56031	
49					106.20
50					90.83
51			SIO2	1.56031	
52					96.82

C1	4.047232E-09	-4.1/5853E-08	-3.889430E-06	0.001009E-09	0.001003E-03
C2	8,449241E-13	-5.621416E-13	2.260825E-13	2.899240E-13	2.899240E-13
C3	5.603175E-17	-2.909466E-19	9.880822E-18	-1.932302E-17	-1.932302E <b>-</b> 17
C4	-4.004583E-21	3.690043E-22	-2.672567E-22	1.602360E-21	1.602360E-21
C5	-8.168767E-25	2.119217E-26	4.717688E-26	-6.342246E-26	-6.342246E-26
C6	2.123279E-29	-9.535588E-31	-3.817055E-30	1.183564E-30	1.183564E-30
SRF	34	39	44	46	52
K	0	0	0	0	0
C1	-3.889430E-08	-2.037803E-08	-1.157857E-08	-1.157857E-08	-2.037803E-08
C2	2.260825E-13	-6.612137E-13	1.455623E-12	1.455623E-12	-6.612137E-13
C3	9.880822E-18	2.840028E-17	-5.746524E-17	-5.746524E-17	2.840028E-17
C4	-2.672567E-22	-4.931922E-21	1.261354E-21	1.261354E-21	-4.931922E-21
C5	4.717688E-26	4.142905E-25	4.054615E-25	4.054615E-25	4.142905E-25
C6	-3.817055E-30	-1.562251E-29	-2.761361E-29	-2.761361E-29	-1.562251E-29
055	50	62	65	67	
SRF	58	02	00	0	
K	0	•	-9.489171E-09	-1.782977E-08	
C1	-1.679180E-08	-1.483428E-08 -2.269457E-14	5.001612E-13	9.574096E-13	
C2	-5.846864E-14		-1.283531E-17	7.878477E-17	
C3	7.385649E-18	4.944523E-18	-8.674473E-23	-7.167182E-21	
C4	-5.142028E-22	-1.410026E-22		2.682224E-25	
C5	1.479187E-26	1.643655E-27	7.103644E-27	-3.423260E-30	
C6	-2.189903E-31	-7.668842E-33	-7.251904E-32	-3,4232001-30	

Tabelle 5 zum Beispiel Figur 7

SURF	RADIUS	THICKNESS	MATERIAL	INDEX	SEMIDIAM.
0	0.0000	32.0000			65.50
1	0.0000	0.0000			80.46
2	3568.5495	29.3610	CAFUV	1.555560	80.77
3	-306.4778	50.8080			84.99
4	-495.7015	32.5298	CAFUV	1.555560	97.37
5	-161.1181	81.4155			99.50
6	188.0753	36.2525	CAFUV	1.555560	93.00
7	-1013.7352	6.1886			90.93
8	288.3482	26.9703	CAFUV	1.555560	82.17
9	872.7887	32.5801			74.60
10	0.0000	47.8395			57.76
11	-76.3176	12.9591	CAFUV	1.555560	65.40
12	-82.8195	72.8834			71.21
13	494.0581	30.0025	CAFUV	1.555560	105.98
14	500.2689	0.9499			109.01
15	210.1705	55.9335	CAFUV	1.555560	115.54
16	-462.2471	0.9442			114.96
17	191.5029	28.1484	CAFUV	1.555560	104.19
18	469.5739	3.8083			100.65
19	313.4359		CAFUV	1.555560	99.24
20	161.6230	115.1964			91.07
21	0.0000	14.7967			90.40
22	0.0000	-100.0183			206.37
23	-247.2670	-56.5211	CAFUV	1.555560	148.25
24	1546.1350	-403.3917			147.84
25	500.0000	-25.0000	CAFUV	1.555560	142.88
26	-2059.5717	-87.3199			147.68
27	173.4701	-25.0000	CAFUV	1.555560	148.30
28	823.5657				193.66
29	295.8639			4 555500	204.70
30	823.5657		CAFUV	1.555560	
31	173.4701	87.3199		4 555500	148.30
32	-2059.5717		CAFUV	1.555560	147.68 142.88
33	500.0000			1 55560	
34	1546.1350		CAFUV	1.555560	148.25
35	-247.2670				125.86
36	0.0000				89.12
37	0.0000 0.0000				149.02
38 39			CAFUV	1.555560	
40				1.000000	90.02
40	-126.6780		CAFUV	1.555560	
42				1.00000	169.01
43					171.87
44			CAFUV	1.555560	
45					120.92
46	•				81.94
47			CAFUV	1.555560	
48				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	91.59
49					133.74
50				1.555560	
51	529.2614				127.08
52			CAFUV	1.555560	
JZ	0-100.00-10	2 1.0001	<del>- •</del>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

53	-202.6253	25.2464			142.97
54	-1447.9251	63.0634	CAFUV	1.555560	168.91
55	-254.3816	80.5189			174.93
56	783.5550	57.0370	CAFUV	1.555560	203.06
57	-939.7625	70.4486			203.12
58	358.1334	55.4484	CAFUV	1.555560	186.96
59	5861.2627	0.9614			184.33
60	259.9889	36.5173	CAFUV	1.555560	161.62
61	371.5128	0.8975			156.47
62	134.7936	77.4909	CAFUV	1.555560	127.53
63	767.8631	0.7967			119.07
64	72.9080	48.3195	CAFUV	1.555560	70.97
65	29.7284	27.0563	IMMO16	1.600000	31.25
66	0.0000				19.39
	Tabelle 6				
	ASPHERISCHE	KONSTANTEN	Zu Tab.5 Fig. 7		
SRF	3	9	19	24	26
K	0	0	0	0	0
C1	2.172737E-08	8.983641E-08	-5.825972E-08	-1.605889E-08	-2.779244E-10
C2	1.718631E-12	-5.996759E-12	-6.306762E-13	4.504977E-16	-3.062909E-14
C3	1.514127E-16	6.363808E-16	-2.783920E-17	3.596627E-21	1.861506E-18
C4	-2.716770E-22	-3.998733E-20	-1.594705E-21	2.792862E-22	-2.425072E-22
C5	-1.008203E-24	-5.130142E-24	2.956685E-25	-1.885291E-26	1.114443E-26
C6	-1.157181E-28	1.266998E-28	-1.064251E-29	3.351694E-31	-2.553147E-31
SRF	28	30	32	34	39
K	0	0	0	0	0
C1	4.632690E-09	4.632690E-09	-2.779244E-10	-1.605889E-08	-1.815667E-08
C2	-3.213384E-14	-3.213384E-14	-3.062909E-14	4.504977E-16	-2.488991E-13
C3	7.229632E-20	7.229632E-20		3.596627E-21	2.824306E-17
C4	2.100335E-23	2.100335E-23		2.792862E-22	-4.697303E-21
C5	-5.592560E-28	-5.592560E-28	1.114443E-26	-1.885291E-26	3.415362E-25
C6	6.249291E-33	6.249291E-33	-2.553147E-31	3.351694E-31	-9.509214E-30
SRF	42	44		54	59
K	0	0		0	0
C1	-9.514646E-09	-9.514646E-09		-1.031964E-08	8.72E-09
C2	1.336864E-13	1.336864E-13		-1.081794E-13	-2.71E-13
C3	-4.722253E-18	-4.722253E-18		6.909628E-18	1.07E-17
C4	1.120165E-22	1.120165E-22		-3.648077E-22	-6.07E-22
C5	-1.895395E-27	-1.895395E-27		9.693996E-27	1.40E-26
C6	1.489410E-32	1.489410E-32	-9.509214E-30	-1.380442E-31	-1.10E-31
SRF	61	63	3		
K	0	C			
C1	-2.45E-08				
C2	6.62E-13				
C3	-1.32E-17				
C4	6.68E-22				
C5	-1.47E-26				
C6	1.14E-31	-3.84E-30	)		

Tabelle 7 Beispiel Figur 8

SURF	RADIUS	THICKNESS	MATERIAL	INDEX	SEMIDIAM.
0	0.0000	32.0000			65.50
1	0.0000	0.0000			80.45
2	361.5503	30.0063	SIO2	1.560318	83.87
3	3766.1854	29,9775			86.87
4	-313.0243	17.3177	SIO2	1.560318	90.72
5	-211.2930	182.7697			93.19
6	-709.0001	29.1631	SIO2	1.560318	120.83
7	-255.7121	13.1321			122.28
8	261.1325	45.4463	SIO2	1.560318	118.65
9	-728.3260	29.9790			116.70
10	-209.1405	18.3161	SIO2	1.560318	113.35
11	-2675.8307	4.7872			113.10
12	421.7508		SIO2	1.560318	112.42
13	-5576.5014				111.29
14	0.0000				103.93
15	249.8044		SIO2	1.560318	163.42
16	-4441.8089				161.31
17	247.2422		SIO2	1.560318	135.08
18	797.4045				130.81
19	665.9047		SIO2	1.560318	108.60:
20	318.3673				96.83
21	0.0000				79.40
22	0.0000		REFL		122.85
23	-145.3105		SIO2	1.560318	107.21
24	-705.3999				104.90
25	-149.2286	-15.0000	SIO2	1.560318	100.69
26	-107.5358	-125.6003			91.50
27	398.2665	-15.0000	SIO2	1.560318	101.84
28	419.3212	-44.0802			104.16
29	398.6744	44.0802	REFL		107.66
30	419.3212	15.0000	SIO2	1.560318	
31	398.2665				101.84
32			SIO2	1.560318	
33					100.69
34			SIO2	1.560318	
35					107.21
36					130.84
37					99.43
38				4 700040	210.81
39				1.560318	
40				4 500046	102.52
41				1.560318	
42				4 500046	110.48
43				1.560318	
44					88.88 89.38
45				1 560210	
46				1.560318	72.67
47				1 ERD210	
48				1.560318	111.71
49					92.32
50				4 560046	
51				1.560318	101.23
52	250.9147	7 -20.0000	•		101.23

53	. 0.0000	209.4519	REEI		135.07
53 54	-133.9081	9.4987		1.560318	97.71
	406.9979	48.9711	GIOZ	1.000010	119.82
55 56		41.1332	SIO2	1.560318	135.89
56 57	-523.9173	29.8664	0102	1.000010	142.55
57	-224.0541	94.8234	6103	1.560318	191.42
58	1367.6570		3102	1.500510	198.87
59	-271.7647	8.1788	CIO	1.560318	232.81
60	667.9279	83.6854	5102	1.500510	233.01
61	-808.5395	140.7841	0100	4 560040	201.18
62	286.6775	82.6895	SIO2	1.560318	198.76
63	-1096.4782	0.9668	0100	4 500040	164.87
64	350.5350	35.6242	SIO2	1.560318	
65	884.2685	0.9173			159.58
66	115.9293	64.9068	SIO2	1.560318	108.97
67	412.6826	0.8041			99.04
68	57.1792	41.0408		1.501403	55.06
69	99.9106	10.1713	IMMO16	1.600000	30.68
70	0.0000				19.40
	Tabelle 8				
	ASPHERSICHE	KONSTANTEN	Zu Tab.7 Fig. 8		
SRF	3	19	24	28	30
K	0	0	0	0	0
C1	-1.001534 <b>E-</b> 09	-4.128786E-08	-4.510495E-08	1.339665E-08	1.339665E-08
C2	6.144615E-13	-4.980750E-13	6.742821E-13	1.482582E-12	1.482582E-12
C3	1.247768E-16	2.649167E-18	3.004246E-17	-1.857530E-16	-1.857530E-16
C4	-1.048854E-20	5.315992E-22	2.453737E-21	3.433994E-20	3.433994E-20
C5	-4.463818E-25	-6.165935E-27	-3.687563E-25	-2.905941E-24	-2.905941E-24
C6	6.154983E-30	1.945950E-32	-1.491146E-30	1.237374E-28	1.237374E-28
SRF	34	39	44	46	52
K	0	0	0	0	0
C1	-4.510495E-08	-2.582589E-08	-1.589920E-08	-1.589920E-08	-2.582589E-08
C2	6,742821E-13	-4.336537E-13	1.112204E-12	1.112204E-12	-4.336537E-13
C3	3.004246E-17	5.153775E-17	-2.537422E-17	-2.537422E-17	5.153775E-17
C4	2.453737E-21	-7.829187E-21	-5.148293E-21	-5.148293E-21	-7.829187E-21
C5	-3.687563E-25	5.696031E-25	8.322199E-25	8.322199E-25	5.696031E-25
C6	-1.491146E-30	-1.711252E-29	-2.485886E-29	-2.485886E-29	-1.711252E-29
•	***************************************				
SRF	58	62	65	67	
K	0			0	
C1	-1.313863E-08			-4.599046E-10	
C2	1.817234E-14			3.983791E-12	
C3	2.355838E-18			-1.382332E-16	
C4	-1.447425E-22			-2.858839E-21	
C5	3.333235E-27			4.614539E-25	
		,, L			
C6	-4.355238E-32	-4.766510E-32	-9.483899E-31	-1.411510E-29	

#### Patentansprüche

Projektionsobjektiv einer mikrolithographischen 1. Projektionsbelichtungsanlage (110) zur Abbildung einer in einer Objektebene (122) des Projektionsobjektivs (120; 120'; 120'') anordenbaren Maske (124) auf eine in einer 5 Bildebene (128) des Projektionsobjektivs anordenbare lichtempfindliche Schicht (126), wobei das Projektionsobjektiv (120; 120'; 120'') für einen Immersionsbetrieb ausgelegt ist, bei dem eine Immersionsflüssigkeit (134) an die 10 lichtempfindliche Schicht (126) angrenzt, wobei die Brechzahl der Immersionsflüssigkeit (134) vorzugsweise größer ist als die Brechzahl eines bildseitig letzten optischen Elements (L5; L5'') des Projektionsobjektivs (120; 120'; 120''), 15

dadurch gekennzeichnet, daß

25

das Projektionsobjektiv (120; 120'; 120'') so

ausgelegt ist, daß die Immersionsflüssigkeit (134)

im Immersionsbetrieb zur Objektebene (122) hin

konvex gekrümmt ist.

2. Projektionsobjektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Immersionsflüssigkeit (134) im Immersionsbetrieb unmittelbar an eine konkav

gekrümmte bildseitige Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) angrenzt.

3. Projektionsobjektiv nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte bildseitige Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) umfangsseitig von einer Ablaufsperre (140) umgeben ist.

9091.5

5

- 4. dadurch gekennzeichnet, daß die Ablaufsperre als
  Ring (140) ausgebildet ist, der mit dem bildseitig
  letzten optischen Element (L5) verbunden ist.
  - 5. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die bildseitige Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) zumindest im wesentlichen kugelschalenförmig ist.
- 6. Projektionsobjektiv nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Krümmungsradius (R) der bildseitigen Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) zwischen dem 0,9fachen und dem 1,5fachen und vorzugsweise das 1,3fache des axialen Abstandes (d) zwischen der bildseitigen Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) und der Bildebene (128) beträgt.

- 7. Projektionsobjektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich im Immersionsbetrieb zwischen dem bildseitig letzten optischen Element (L5'') des Projektionsobjektivs (120'') und der Immersionsflüssigkeit (134) eine nicht mit der Immersionsflüssigkeit (134) mischbare Zwischenflüssigkeit (142) befindet, die in einem elektrischen Feld zu der Immersionsflüssigkeit (134) eine gekrümmte Grenzfläche (139, 139') ausbildet.
- 8. Projektionsobjektiv nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenflüssigkeit (142) elektrisch leitfähig und die Immersionsflüssigkeit (134) elektrisch isolierend ist.
- 9. Projektionsobjektiv nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenflüssigkeit (142) im wesentlichen die gleiche Dichte wie die Immersionsflüssigkeit (134) hat.
- 10. Projektionsobjektiv nach Anspruch 9, dadurch
  20 gekennzeichnet, daß die Immersionsflüssigkeit (134)
  ein Öl und die Zwischenflüssigkeit (142) Wasser
  ist.
- 11. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 7 bis
   10, gekennzeichnet durch eine Elektrode (146) zur
   25 Erzeugung des elektrischen Feldes.

12. Projektionsobjektiv nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrode eine ringförmige Kegelelektrode (146) ist, die zwischen dem bildseitig letzten optischen Element (L5'') und der Bildebene (128) angeordnet ist.

5

10

15

- 13. Projektionsobjektiv nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß sich durch Verändern einer an die Elektrode (146) angelegten Spannung die Krümmung der Grenzfläche (139, 139') verändern läßt.
- 14. Projektionsobjektiv nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Grenzfläche (139, 139') zwischen der Zwischenflüssigkeit (142) und der Immersionsflüssigkeit (139) zumindest näherungsweise kugelschalenförmig ist.
- 15. Projektionsobjektiv nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Projektionsobjektiv (120) ein katadioptrisches Objektiv mit mindestens zwei gekrümmten Spiegeln (S1, S2) ist, das mindestens zwei Zwischenbilder aufweist.
- 16. Mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage zur Herstellung mikrostrukturierter Bauteile, gekennzeichnet durch ein Projektionsobjektiv (120;

120'; 120'') nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

- 17. Verfahren zur mikrolithographischen Herstellung mikrostrukturierter Bauelemente mit folgenden Schritten:
  - a) Bereitstellen eines Trägers (130), auf den zumindest teilweise eine Schicht (126) aus einem lichtempfindlichen Material aufgebracht ist;
- b) Bereitstellen einer Maske (124), die abzubildende Strukturen enthält;
  - c) Bereitstellen einer Projektionsbelichtungsanlage mit einem Projektionsobjektiv (120; 120', 120'') nach einem der Ansprüche 1 bis 15;
- d) Projizieren wenigstens eines Teils der Maske (124) auf einen Bereich auf der Schicht (126) mit Hilfe der Projektionsbelichtungsanlage.
  - 18. Mikrostrukturiertes Bauelement, das nach einem Verfahren nach Anspruch 17 hergestellt ist.
  - 19. Mikrolithographisches Objektiv mit einer konkaven objektseitig letzten Linse, angepasst zur Verwendung mit einem Immersionsmedium zwischen letzter Linse und

Bildebene, in der insbesondere ein Wafer, oder ein Photolack angeordnet ist, bei dem der Sinus des maximalen Inzidenzwinkels eines Lichtstrahles an der Grenzflächevon letzter Linse zum Immersionsmedium in der Linse zwischen 0.5 und 0.98, vorzugsweise zwischen 0.85 und 0.95 beträgt.

## Zusammenfassung

Bei einem für einen Immersionsbetrieb ausgelegten Projektionsobjektiv (120; 120', 120'') einer mikrolithographischen Projektionsbelichtungsanlage (110) ist die Brechzahl der Immersionsflüssigkeit (134) größer als die Brechzahl eines bildseitig letzten optischen Elements (L5; L5''). Das Projektionsobjektiv ist so ausgelegt, daß die Immersionsflüssigkeit im Immersionsbetrieb zur Objektebene (122) hin konvex gekrümmt ist. Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, daß die Immersionsflüssigkeit unmittelbar an eine konkav gekrümmte bildseitige Fläche (136) des bildseitig letzten optischen Elements (L5) angrenzt. Bei einer alternativen Ausgestaltung befindet sich zwischen dem bildseitig letzten optischen Element (L5'') des Projektionsobjektivs (120'') und der Immersionsflüssigkeit (134) eine nicht mit der Immersionsflüssigkeit mischbare Zwischenflüssigkeit (142), die in einem elektrischen Feld zu der Immersionsflüssigkeit (134) infolge des sog. "Electrowetting"-Effekts eine gekrümmte Grenzfläche (139, 139') ausbildet. Infolge der konvexen Krümmung der Immersionsflüssigkeit zur Objektebene hin ist die erzielbare numerische Apertur nur durch die Brechzahl der Immersionsflüssigkeit, nicht aber durch die Brechzahl des bildseitig letzten optischen Elements begrenzt.

(Figur 2)

Schicht angrenzt. Erfindungsgemäß ist zur der Zeichnung. Darin zeigen:

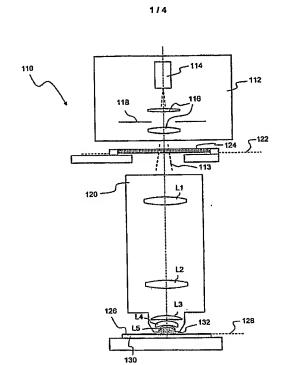


Fig. 1

9091.5

Die Figur 1 zeigt einen

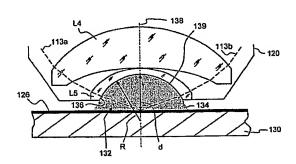


Fig. 2

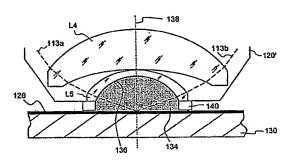
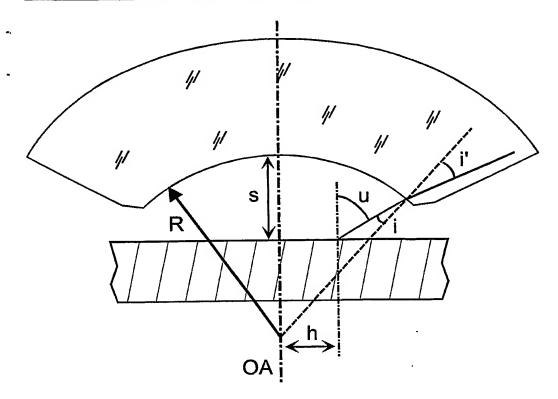


Fig. 3

9091.5

Die Fläche 136 ist annährend kugelschalenförmig, wobei der Krümmungsradius in der Figur 2 einer



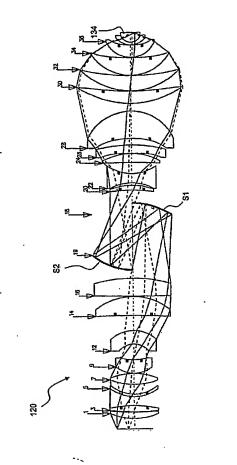
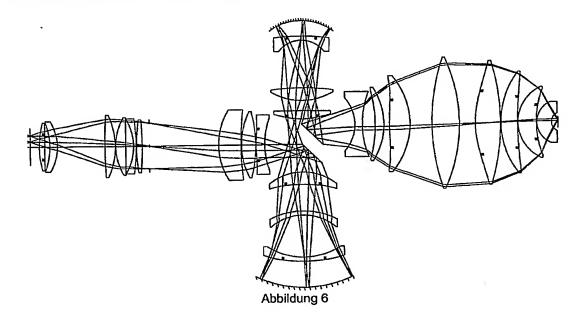
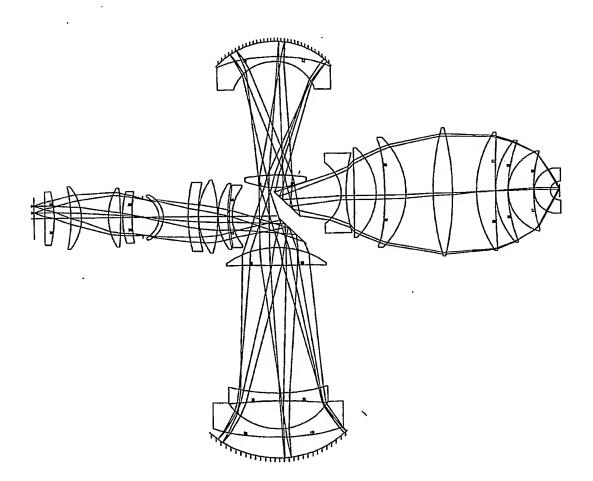


Fig. 5

numerische Apertur NA = 1.4, das Immersionsmedium hat eine Brechzahl von n = 1.6.





Krümmungsradius der letzten Linsenfläche minimal augelegt wurde.

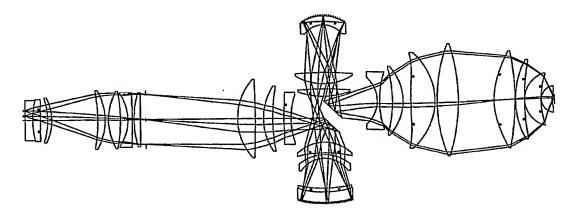


Abbildung 8

aufgenommen wird.

48.3195

E204268MRa.doc

Beispiel (Figur 8)

E204268MRa.doc

E204268MRa.doc SURF RADIUS

THICKNESS

MATERIAL

INDEX

Seite 16 von 44 SEMIDIAM.

0.0000

32.0000

65.50

 1
 0.0000
 0.0000
 80.45

 2
 361.5503
 30.0063
 1.560318
 83.87

 3
 3766.1854
 29.9775
 86.87

E204268MRa.doc

Seite 17 von 44

41.56031890.72593.1961.560318120.83

E204268MRa.doc Seite 18 von 44

1.560318

122.28 118.65

E204268MRa.doc 9

1.560318

164.87

-4.355238E-32 -4.766510E-32 -9.483899E-31 -1.411510E-29 C6